



PIB-20

# イオンボンバーダー

多目的プラズマ処理装置

- 様々な用途に対応することを可能にする調整機能を装備。
- 条件出し完了後はボタン1つでフルオート動作。
- $\phi 140\text{mm}$  の大型試料ステージ採用で、大きなサンプルも処理可能。
- 雰囲気ガス導入付きで有機材料のソフトエッチングも可能です。
- PDMS+ガラス、又はPDMS+PDMSの貼り付けが容易に可能です。
- テフロン試料台装着で、電顕用支持膜の親水処理も行えます。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: [device@shinkuu.co.jp](mailto:device@shinkuu.co.jp)

## 特徴・仕様

### 特徴

- ★ この装置は親水処理や有機素材のエッチングなどに使用する装置です。主に電子顕微鏡試料の支持膜親水化、PDMS の貼り付け、油脂・有機材料などのエッチング（クリーニング）に使用します。
- ★ 雰囲気ガスの導入・圧力調整機能を装備しています。ガスやガス導入量の調整であらゆる分野の研究などに役立ちます。
- ★ 試料台は大型サンプルをそのまま処理を可能にする大面積フラットステージを採用。電界のムラやコンタミネーションの付着を防止します。
- ★ マニュアル調整も右からボタンを順に押すだけのオペレーターに易しいレイアウト。
- ★ 調整・条件出し完了後は、中央のオートコントロール スイッチを押すだけ。
- ★ 排気速度と放電条件のバランスを重視して、2系統の排気管を自動制御。
- ★ リーク速度を抑えて、サンプルの移動・転倒などの発生を低減。
- ★ イオンダメージに弱いサンプル・熱ダメージに弱いサンプルを処理するため、テフロン製補助試料台も標準で付属。

### 仕様

No	項目	仕様
1	電極円盤	φ 66mm SUS 製
2	放電電圧／電流	電圧 AC0～700V／電流 AC0～50mA
4	試料ステージ	φ 140mm
5	電極円盤－試料間隔	35mm
6	試料サイズ	φ 130mm 以下、高さ 25mm 以下
7	チャンバーサイズ	内径 149mm×深さ 82mm
8	タイマー	OMRON 社製電子タイマー
9	排気系	外置き RP50ℓ/min 10kg
10	安全対策	系統別フューズ、上蓋開放感知センサー
11	装置サイズ	本体 W354mm×H351mm×D420mm 15kg
12	電源	AC100V, 10A アース線付3芯プラグ使用3m

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。